

化学気相成長Cvd装置システム チャンバースライド式 Pecvd管状炉

液体気化器付き Pecvdマシン

商品番号: KT-PE12



前書き

KT-PE12

スライド式PECVDシステム：広い出力範囲、プログラム可能な温度制御、スライドシステムによる急速加熱/冷却、MFC質量流量制御および真空ポンプを搭載

。

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-PE12-60
最高温度	1200°C
常用温度	1100°C
炉管材質	高純度石英
炉管径	60mm
加熱ゾーン長	1x450mm
チャンバー材質	日本産アルミナファイバー
加熱エレメント	Cr2Al2Mo2 ワイヤークoil
昇温速度	0-20°C/min
熱電対	内蔵Kタイプ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1°C
スライド距離	600mm
RFプラズマユニット	
出力電力	5 -500W 調整可能（安定性 ± 1%）
RF周波数	13.56 MHz（安定性 ±0.005%）
反射電力	最大350W
マッチング	自動
ノイズ	<50 dB
冷却	空冷
ガス精密制御ユニット	
流量計	MFC質量流量計

ガスチャンネル	4チャンネル
流量	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCM CH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
直線性	±0.5% F.S.
再現性	±0.2% F.S.
配管およびバルブ	ステンレス鋼
最大動作圧力	0.45MPa
流量計コントローラー	デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー
標準真空ユニット（オプション）	
真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ排気速度	4L/S
真空吸気口	KF25
真空計	ピラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧	10Pa
高真空ユニット（オプション）	
真空ポンプ	ロータリーベーンポンプ + 分子ポンプ
ポンプ排気速度	4L/S + 110L/S
真空吸気口	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧	6x10-4Pa

上記の仕様およびセットアップはカスタマイズ可能です

No.	名称	数量
1	電気炉本体	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	炉管断熱ブロック	2
5	断熱ブロック用フック	1
6	耐熱手袋	1
7	RFプラズマソース	1
8	精密ガス制御装置	1
9	真空ユニット	1
10	取扱説明書	1